



DSC 2000

DESKTOP SPUTTER COATER

磁控溅射仪

采用一线品牌无油干泵和分子泵组产生一个洁净的 10^{-3} Pa的真空压强，通常抽真空时间小于15分钟。

采用高品质恒功率磁控溅射电源，确保恒定镀膜沉积速率。并配备自动旋转升降样品台，可加偏压和等离子体源用于基片的清洗、活化。特别适用于4-6英寸金属薄膜电极的制备，可实现好的薄膜厚度、性能均匀性以及优秀的薄膜附着力。

操作便捷，触摸屏PC菜单可编辑工艺软件实现自动控制。
即插即用。无需额外冷却水，无需380V强电，无需压缩空气。
设备紧凑、静音，占地面积小。



双靶！

可配Plasma清洗源！

工艺编辑软件！
自动Recipe控制！

即插即用！
触摸屏PC控制！

SuPro Instruments LTD
速普仪器

Nanshan ,
Shenzhen, China

[Http://www.suproinst.com](http://www.suproinst.com)

Tel: 86-755-26642901

Fax: 86-755-26419205

技术规格	参数
主要用途	金属薄膜电极
真空泵组	标配直流电机静音油泵+分子泵组/ 可选配干泵
泵组抽速	>8 m ³ /h 机械泵+240 L/S 分子泵
极限真空	<5*10E-4 Pa
工作气压	典型值: 0.3-1 Pa
抽空时间	<15 Min (<5*10E-3 Pa, 洁净腔体)
真空测量	测量范围大气压到10E-5 Pa, 进口品牌复合真空计
气体控制	两路 MFC 气体质量流量控制器 (50 或 100 SCCM Ar/N ₂)
腔室尺寸	~Ø 300 *170 mm
磁控靶源	靶材尺寸 Ø 75 *0.1-5 mm /2只 可实现单靶溅射/双靶共溅射/交替溅射 带独立挡板, 可溅射贵金属 Au/Pt 等, 或金属 Al、Cr、Ag、Ti 等金属 (通 Ar 气)
溅射电源	恒功率磁控 DC 溅射电源 Max. 300W (可选国产或进口品牌) 偏压 DC 溅射电源 0-400V 电源 (选配)
样品台	6 英寸样品台。系统采用多轴伺服电机控制系统+磁流体密封+波纹管模组, 可以实现样品台自动上下升降 (可调范围不低于 40mm), 以及样品台的旋转 (速度 0-60 RPM 可调)
等离子清洗	可选配 RF 射频等离子清洗源 (50W)
工控模式	提供客户端工艺菜单编辑软件。可以实现工艺菜单灵活编辑 (可以在工艺编辑软件进行模块化的工艺菜单编辑) + 工艺菜单自动控制执行模式 (载入工艺菜单, 支持实现无人值守或远程网络控制镀膜)
操作方式	触摸屏控制/电脑远程网络控制
重量尺寸	~80 Kg / 600 mm 宽*600 mm 深*1200 mm 高
输入电源	220V AC, 50/60Hz 接地三脚插头
输入功耗	< 3000 W
冷却方式	标配水冷机
质量保证	一年免费/终身维护
备注	以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知, 如有疑问请联系我们



深圳市速普仪器有限公司

地址: 深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009

电话: 0755-26642901 传真: 0755-26419205

邮件: sales@suproinst.com

Http://www.suproinst.com

深圳市速普仪器有限公司 (北京办事处)

地址: 北京市海淀区太平路甲40号金玉元E座105室

电话: 010-63839091 传真: 010-63839091

邮件: zkchang@suproinst.com